«УТВЕРЖДАЮ»

И.О. директора ФГУП

«НИИФП им. Ф В.Лукина»

Козлов А.И.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о Центре коллективного пользования

«СИНХРОТРОН»

### 1. Общие положения.

1.1. Центр коллективного пользования  «Синхротрон», именуемый в дальнейшем ЦКП, образован на базе ФГУП «НИИФП им. Ф В.Лукина»  Приказом ФГУП «НИИФП им. Ф В. Лукина» № 93 от 10 мая 2003 г.

1.2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, дом 5; почтовый адрес – 124460, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 5

1.3. ЦКП руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами ФГУП «НИИФП им. Ф В.Лукина».

1.4. Основными направлением деятельности ЦКП является:

 обеспечение проведения исследовательских работ на имеющемся в ЦКП оборудовании;  
 оказание услуг исследователям и научным коллективам как базовой организации, участникам, так и иным заинтересованным пользователям.

1.5. Основными задачами ЦКП являются:

1.5.1. обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным пользователям и сторонним организациям.

1.5.2. проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках основных направлений деятельности и с применением аналитической и технологической базы ЦКП; повышение уровня загрузки научного оборудования в ЦКП;  
1.5.3. обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных исследований на оборудовании ЦКП;

1.5.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования ЦКП;  
1.5.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП.

1.6.Научные направления деятельности ЦКП в соответствии с перечнем критических технологий развития науки, технологий и техники Российской Федерации (утверждены Указом  Президента РФ от 07.07.2011 N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечня критических технологий РФ"), а именно:

1. разработка технологий перспективной элементной базы наноэлектроники с проектными нормами 32 – 8 нм;
2. разработка технологий перспективной элементной базы МЭМС и НЭМС.
3. развитие нового направления электронной компонентной базы, объединяющей МЭМС, наноэлектронику и физические эффекты;
4. ориентация предприятия на решение текущих задач Минпромторга России по развитию нанотехнологий и радиоэлектроники, включая оказание услуг и проведение совместных исследований перспективных материалов и элементов наноэлектроники с проектными нормами 90 - 32 нм.
5. коллективное использование современного аналитического и технологического оборудования (в том числе технологических и аналитических станций, использующих синхротронное излучение), методических и метрологических разработок ЦКП при выполнении фундаментальных и прикладных исследований по проектам региональных, федеральных и международных программ в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники и критическими технологиями федерального уровня.

2. Структура ЦКП.

2.1. ЦКП включает в себя  следующие подразделения:    
- лаборатория физико-аналитических исследований;  
- сектор технического обслуживания;  
- испытательная лаборатория;

- сектор метрологического обеспечения.

### 3. Оборудование ЦКП.

3.1. Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП для обеспечения его деятельности,  указан в Приложении 1.Перечень оборудования уточняется ежегодно.  
3.2. Обеспечение деятельности ЦКП в подразделениях ФГУП «НИИФП им. Ф В.Лукина» осуществляется самостоятельно, в том числе в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение работ по развитию сети ЦКП.

3.3.ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, предусмотренных настоящим Положением.

### 4. Организация деятельности ЦКП:

4.1. Общее руководство деятельностью ЦКП  осуществляется руководителем ЦКП;

4.2. Структура, списочный состав, штатное расписание, должностные инструкции сотрудников ЦКП утверждается ежегодно директором ФГУП «НИИФП им. Ф В.Лукина» по представлению руководителя ЦКП;

4.3. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг определяет руководитель базовой организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.. Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.

4.6. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между организацией-заказчиком и ФГУП «НИИФП им. Ф В.Лукина».

4.7. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет директор ФГУП «НИИФП им. Ф В.Лукина».

5. Прекращение деятельности и ликвидация ЦКП.

5.1. Прекращение деятельности и ликвидация ЦКП осуществляется в установленном порядке на основании приказа директора ФГУП «НИИФП им. Ф В.Лукина»

Руководитель

ЦКП «Синхротрон» А.И. Козлитин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 1

## Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование оборудования** | **Год выпуска** |
|  | Растровый электронный микроскоп Cambridge Instruments | 1988 |
|  | Вторично-ионный масс спектрометр IMS - 4f | 1990 |
|  | Просвечивающий электронный микроскоп Tecnai G2 20 | 2007 |
|  | Оже электронный спектрометр PHI 660 | 1993 |
|  | Сканирующий зондовый микроскоп Solver Pro-M | 2005 |
|  | Энергодисперсионная приставка Inca Energy 350 | 2005 |
|  | Волнодисперсионный спектрометр Inca Wave 700 | 2008 |
|  | Измеритель угла смачивания CAM 101 | 2006 |
|  | ИК-Фурье спектрометр Spectrum 1000 | 2008 |
|  | Профилометр Alpha-step 200 | 1989 |
|  | Сверхвысоковакуумный модуль сканирующего зондового микроскопа SPM01 | 2009 |
|  | Аналитико-технологический модуль вторично-ионной масс-спектроскопии и наноэлектронной имплантации | 2009 |